

1.バルブを開ける

- 天井のバルブを3箇所開ける。バルブに繋がるパイプには“Si エッチャー”と書いてある。

(図1 参照)

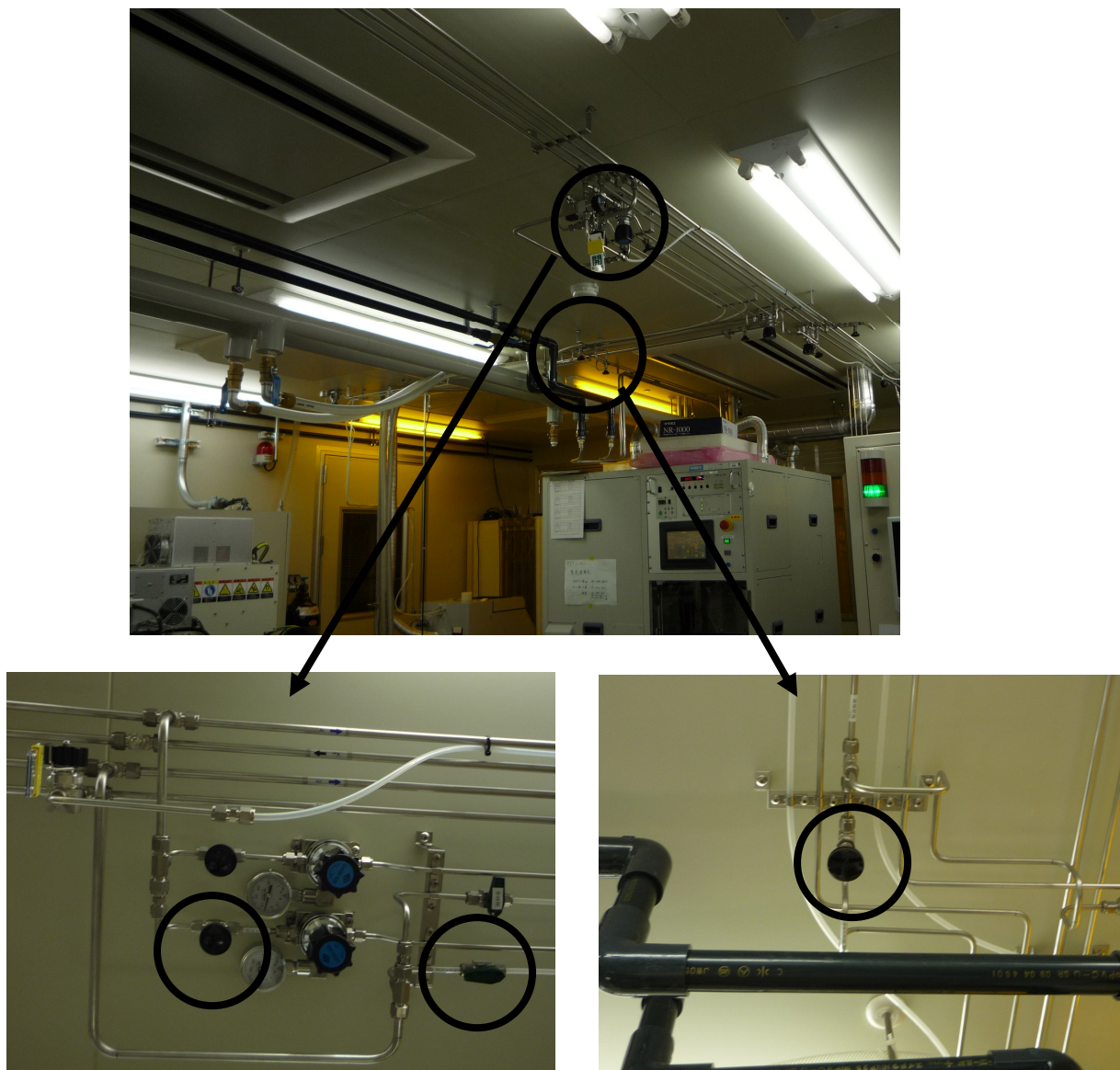


図1 天井のバルブ

## 2.装置立ち上げ

- ・本体のブレーカを ON にする。
- ・メインスイッチを ON にする。
- ・本体裏のカバーを取り、XeF<sub>2</sub> の元栓が完全に閉まっているのを確認して、パネルの“システム起動”を押す。

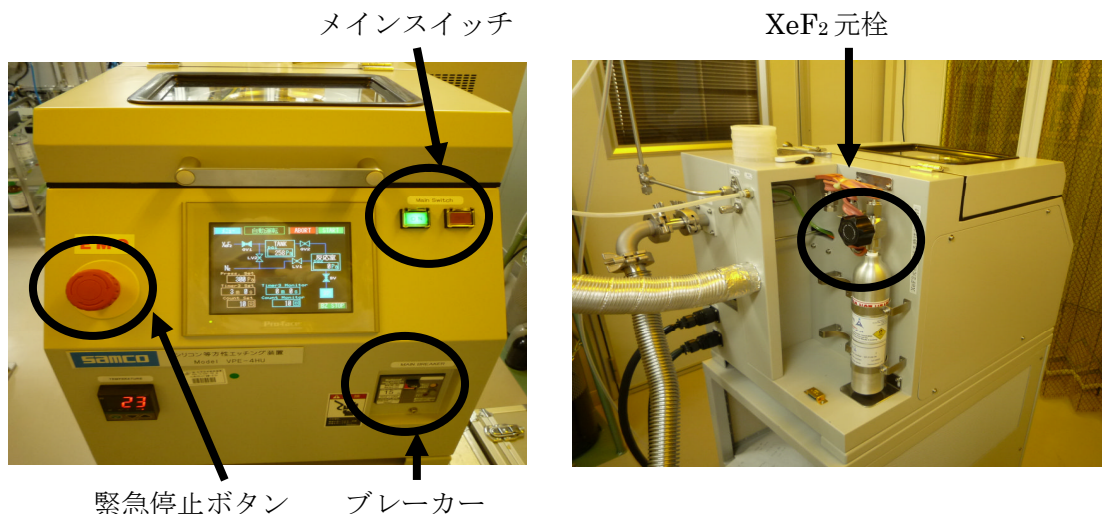


図 2 XeF<sub>2</sub> 本体

## 3.自動運転設定

- ・メイン画面の“自動運転設定”を押す。
- ・TANK 圧力、エッチング時間、エッチング回数、サイクルパーージ回数を入力。

## 4.自動運転

- ・試料をチャンバ内に入れる。
- ・メイン画面の“自動運転”を押す。
- ・画面右上“START”を長押しする。
- ・画面の“DC1(TANK 圧力)”を見ながら XeF<sub>2</sub> の元栓を少しずつ開けて、1 秒に 1~3Pa 程度上昇するようにする。(大きく開けると、設定した圧力より高い圧力でガスが入る。)
- ・設定したエッチング回数が終了すると、自動でサイクルパーージとベントを行ってくれる。
- ・途中でエッチングを中止したいときは、“ABORT”を長押しする。反応室がサイクルパーージされてからベントされる。

## 5.装置立ち下げ

- ・XeF<sub>2</sub> の元栓を閉める。
- ・メイン画面の“システム終了”を押す。
- ・システム終了が完了した後、メインスイッチとブレーカーを OFF する。
- ・天井のバルブを 3 箇所閉める。